

簡稱	FE-SEM
中文名稱	場發射掃描式電子顯微鏡
英文名稱	Field Emission Scanning Electron Microscope
圖片	
功能說明	試片表面及截面幾何形狀觀測、凹凸面陰影觀測、元素鑑別及分析、觀測區域選定、調整景深及清晰度、數位螢幕顯示、材質含金屬、非金屬及無機物檢測。
儀器服務項目	樣品表面顯微影像、樣品成分半定量分析
儀器購置日期	2009/12/31
儀器廠牌	日本電子公司JEOL
型號	JSM-6701F
儀器規格	二次電子影像偵測器
主要配件	能量發散光譜儀(EDS)、真空蒸鍍儀(鍍金、鍍碳)
樣品準備	固體、薄膜
注意事項	<div>1. 樣品需乾燥，若需特殊處理，需先自行製備。</div> <div>2. 試片在電子束照射下會分解或釋放氣體，因有礙必要之真空維持，恕不受理。</div> <div>3. 本儀器拒絕受理含磁性、腐蝕性、揮發性及不耐高溫之試件。</div> <div>4. 樣品最好為導電及導熱體，大小最大不可超過長2cm、厚0.5cm。</div> <div>為避免造成損壞，本儀器拒絕受理具強磁性、磁性(如鐵、鈷、鎳等)或易被電磁透鏡吸引的粉末型式樣品或材料;拒絕受理含有毒性、腐蝕性、揮發性、低熔點之樣品。</div>
儀器放置位置	工程三館 ES105